智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上字第15號

上　訴　人　羅彥君即翊宇科技企業社

訴訟代理人　蔣昕佑律師
　　陳冠宏律師
　　楊雯欣律師
　　陳豫宛
被上訴人　　上和精密工業有限公司

兼 法 定
代 理 人　　羅彥文

被上訴人　　欣興電子股份有限公司

法定代理人　簡山傑
被上訴人　　曾子章
上二人共同
訴訟代理人　陳軍宇律師
　　黃郁孟律師
輔　佐　人　李昇叡
被上訴人　　加逢實業股份有限公司

法定代理人　黃經國
被上訴人　　泓揚精密工業股份有限公司

兼 法 定
代 理 人　　陳能敏

上二人共同
訴訟代理人　林裕家律師
　　何啓弘

被上訴人　　超登企業有限公司

法定代理人　李宜娟
被上訴人　　李月圓
上二人共同
訴訟代理人　王文成律師
　　劉蘊文律師
　　陳政大

　　蔡孟熹

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國112年5月31日本院111年度民專訴字第12號第一審判決提起上訴，並為訴之擴張，本院於115年6月26日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴及擴張之訴均駁回。

第二審（含擴張之訴）訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行，下稱智審法）第75條第1項前段規定：本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智審法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、按有限公司之清算，以全體股東為清算人（公司法第113條第2項準用第79條前段規定），股份有限公司之清算，以董

事為清算人，但本法或章程另有規定或股東會另選清算人時，不在此限（公司法第322條第1項），解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散，公司法第25條定有明文。上和精密工業有限公司（下稱上和公司）已於112年12月8日解散，惟並未向法院陳報清算人及辦理清算程序（見本院卷一第159-170頁、第233頁、本院卷三第117、246頁），依上開說明，上和公司於清算範圍內，仍應視為尚未解散，並以其唯一股東羅彥文代表上和公司為訴訟上行為。加逢實業股份有限公司（下稱加逢公司）已解散，並向臺灣新北地方法院（下稱新北地院）呈報清算人為黃經國及呈報清算終結，經本院調閱新北地院114年度公司司字第566號、115年度司司字第148號卷宗資料查證無誤（見本院卷三第117頁、第199-203頁），惟本件為加逢公司於解散前所涉侵害專利權所生之損害賠償事件，於該爭議未了結範圍內，加逢公司仍視為存續，而具有當事人能力，並以清算人黃經國代表加逢公司為訴訟上行為。

三、欣興電子股份有限公司（下稱欣興公司）原法定代理人為曾子章，嗣變更為簡山傑，並經簡山傑於115年4月20日具狀聲明承受訴訟（見本院卷三第63-69頁），超登企業有限公司（下稱超登公司）原法定代理人為李月圓，嗣變更為李宜娟，並經李宜娟於115年5月6日具狀聲明承受訴訟（見本院卷三第155-157頁），均合於民事訴訟法第175條規定，應予准許。

四、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，民事訴訟法第385條第1項前段定有明文。加逢公司經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依上訴人之聲請，就加逢公司部分為一造辯論之判決。

五、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之；但請求基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，

不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款、第3款分別定有明文。本件上訴人於原審關於損害賠償部分，係請求欣興公司給付新臺幣（下同）400萬元本息，並就其中200萬元請求上和公司與欣興公司連帶給付，其中100萬元請求泓揚精密工業股份有限公司（下稱泓揚公司）與欣興公司連帶給付，其中100萬元請求超登公司與欣興公司連帶給付，並請求欣興公司、上和公司、泓揚公司、超登公司侵權行為時之負責人曾子章、羅彥文、陳能敏、李月圓4人，與各該公司負連帶責任。嗣上訴人於第二審程序擴張請求之金額，對欣興公司及其法定代理人、上和公司及其法定代理人之請求金額擴張為8,891萬1,159元，泓揚公司及其法定代理人、超登公司及其法定代理人之請求金額擴張為2,963萬7,053元，並依真正、不真正連帶關係更正聲明次序（見本院卷二第189-193頁），惟其所主張之原因事實，均係本於同一侵害專利權行為之基礎事實，僅擴張應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款、第3款規定，應予准許。

六、按攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。當事人不得於第二審程序提出新攻擊或防禦方法，但有447條第1項但書情形，不在此限，當事人就447條第1項但書各款事由，應釋明之。違反前二項之規定者，第二審法院應駁回之。當事人就其主張之爭點，經依第270條之1第1項第3款整理並協議簡化爭點者，應受其拘束。但經兩造同意變更，或因不可歸責於當事人之事由或依其他情形協議顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第196條第1項、第2項前段、第447條、第270條之1第3項定有明文。本件欣興公司關於善意先使用之抗辯，係本院於113年3月27日協同兩造整理爭點之後，且在兩造就專利侵權及有效性互相攻防完畢後，始於114年10月27日民事上訴答辯（六）狀

提出（見本院限閱卷三第12頁），與前開整理爭點之時間相隔一年半以上，顯屬因重大過失逾時提出攻擊防禦方法且有礙訴訟終結，欣興公司雖主張係援用另案專利權移轉登記事件最高法院114年7月30日確定裁判結果（最高法院114年度台上字第1036號民事裁定），惟欣興公司是否提出先使用抗辯，與本件中華民國新型第M588880號「具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具」專利（下稱系爭專利1）、及新型第M606835號「晶圓載片清洗治具」專利（下稱系爭專利2）（系爭專利1、2下合稱系爭專利）之專利權歸屬爭議並無必然關係，亦無必須等待該案件判決確定始得出該抗辯之理，欣興公司之主張尚不足採，上訴人並已就欣興公司逾時提出攻擊防禦方法部分提出異議（見本院卷二第326頁、本院卷三第249頁），欣興公司逾時提出先使用之抗辯，有違上開民事訴訟法之規定，應予駁回。

乙、實體方面：

一、上訴人主張略以：

㈠系爭專利1、2為林璟棠所有，系爭專利1之專利期間為109年1月1日起至118年7月9日止，系爭專利2之專利期間為110年1月21日至119年9月17日止。上訴人為系爭專利1、2之專屬被授權人，授權期間分別自109年1月1日起、110年1月21日起，均至授權標的之專利期間屆滿日止。

㈡欣興公司為上訴人之長期重要客戶，伊前為配合欣興公司新豐廠產線需求，以系爭專利之技術特徵設計開發特殊規格之清洗治具供新豐廠使用。然上訴人於110年4、5月間，發現上和公司竟委託加逢公司製造「SH23×SH23」（下稱系爭產品1）、「SH24.5×24.5-V3」（下稱系爭產品2）後，再以上和公司名義販賣予欣興公司使用；嗣上訴人向本院聲請保全證據，經本院以110年度民聲字第22號裁定准許，於110年11月5日在欣興公司新豐廠區保全證據過程中除扣得上開系爭產品1、2外，另扣得由泓揚公司製造之「HY35×35」（下稱系爭產品3）、超登公司製造之「ZD31×31」（下稱系爭產品4）（系

爭產品1至4下合稱系爭產品）。上開扣得之物，經上訴人取得比對分析後，發現系爭產品1至4落入系爭專利1請求項1至14之文義範圍，系爭產品3另落入專利2請求項1之文義範圍及請求項3至6之均等範圍。而針對上和公司持續委託製造及販賣系爭產品1、2；加逢公司持續受託製造系爭產品1、2；泓揚公司持續製造、為販賣之要約、販賣系爭產品3；超登公司持續製造、為販賣之要約、販賣系爭產品4，以及欣興公司持續使用系爭產品1至4之行為，已違反專利法第120條準用第58條第1、2項之規定，故意侵害上訴人對系爭專利之實施權甚鉅，爰依專利法第120條準用第96條第1至4項、第97條第1、2項、民法第184條第1項前段、民法第185條第1項、公司法第23條第2項，請求被上訴人等就侵害行為連帶負損害賠償責任，並請求被上訴人等排除侵害系爭專利，並應將從事侵害行為之原料與器具予以回收、銷毀。

㈢原審認定系爭產品1至4均未落入專利1請求項1至14之文義範圍，不構成侵害系爭專利1之專利權，且系爭專利2請求項1、3至6均不具進步性而有得撤銷之原因，駁回上訴人之訴，實有認事用法之重大違誤，應予廢棄。

㈣並聲明：

1.原判決廢棄。

2.欣興公司及曾子章應連帶給付上訴人8,891萬1,159元，及其中300萬元自起訴狀繕本送達翌日起，其中100萬元自原審訴之變更追加狀繕本送達翌日起，餘自民事準備三暨擴張聲明狀繕本送達翌日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

3.上和公司應就第二項給付之本金8,891萬1,159元，及其中200萬元自起訴狀繕本送達翌日起，餘自民事準備三暨擴張聲明狀繕本送達翌日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息，與欣興公司負連帶給付責任。

4.羅彥文應就第三項給付與上和公司負連帶給付責任。

5.泓揚公司、超登公司應就第二項給付之本金2,963萬7,053元部分，及其中100萬元自原審訴之變更追加狀繕本送達翌日起，餘自民事準備三暨擴張聲明狀繕本送達翌日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息，分別與欣興公司負連帶給付責任。

6.陳能敏應就第五項給付與泓揚公司負連帶給付責任。

7.陳月圓應就第五項給付與超登公司負連帶給付責任。

8.第二至七項給付，如有任一被上訴人已為給付者，其餘被上訴人於該給付範圍內同免給付義務。

9.加逢公司、上和公司、欣興公司、泓揚公司、超登公司不得自行或使他人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害上訴人系爭專利1之物品；已製造、販賣或使用之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應即回收銷毀之。

10.欣興公司、泓揚公司不得自行或使他人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害上訴人系爭專利2之物品；如已製造、販賣或使用者，應即回收銷毀之。

11.第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。

12.第二至七項聲明如獲有利判決，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

二、上和公司、羅彥文答辯略以：

上訴人的Tray盤產品都是其設計的，其係以上訴人之名義跟欣興公司交涉，並且依照欣興公司需求設計出與系爭專利相同規格不同尺寸的TRAY盤，其在102年11、12月設計出第1組晶圓載板清洗TRAY型號「29*37」，相隔5年多之後，系爭專利才提出申請，故系爭專利應歸屬於伊，上訴人不得對其主張系爭專利之權利。並聲明：上訴及追加之訴駁回。第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。

三、欣興公司、曾子章答辯略以：

㈠系爭產品1至4均未侵害系爭專利1：

系爭專利1請求項1之「複數個卡合凸塊…能與…一傳動裝置相卡合」，能達成「讓放置架更穩定地被傳動裝置輸送，避免晶圓載片震動或彈跳而產生瑕疵，提升輸送穩定度」之功效，為專利1之必要技術特徵，對申請專利範圍產生影響，屬於構成要件，應加以比對、不可忽略。惟由保全證據程序所取得之「00086錄影檔」清洗機台拍攝之生產線影片可知，藍色滾輪皆呈現平滑表面而無任何可與清洗治具之卡合凸塊相卡合之結構，清洗治具自無法與傳送裝置相卡合。另由第三人揚發實業有限公司（下稱揚發公司）回覆本院函詢之內容，亦足以證明欣興公司之清洗機或水洗機使用之「壓制輪」，為「平滑表面」之「滾輪」，無法與系爭產品1至4之「凸塊」「相卡合」，故系爭產品1至4並未侵害專利1。

㈡系爭產品3並未侵害系爭專利2：

系爭專利2說明書第【0021】段記載：「承載件123與晶圓載片20之間是以線接觸的方式貼靠達到承載之目的，…本新型以線接觸的碰撞可有效降低晶圓載片20表面的刮痕，進而提升產品的品質，降低產品的不良率」。第【0003】段記載：「清洗治具的承載件95其頂面96為一平面，與晶圓載片98為面接觸，當晶圓載片98震動時，其貼靠於承載件95的部分則會因為連續的敲擊摩擦而產生大面積的刮痕，導致成品的良率下降；因此，現有技術之晶圓載片清洗治具，其整體構造存在有如前述的問題及缺點，實有待加以改良」，系爭產品3之「抵頂面」係以「面接觸」型式相接，並未落入系爭專利2之專利權範圍。

㈢系爭專利1請求項1至14分別有不具新穎性、進步性之事由，系爭專利2請求項1、3至6分別有不具新穎性、進步性之事由（有效性證據組合詳如言詞辯論意旨㈡狀所載），故上訴人不得對被上訴人等主張權利。

㈣並聲明：1.上訴及追加之訴駁回。2.一、二審訴訟費用由上訴人負擔。3.如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、加逢公司答辯略以：

加逢公司未於言詞辯論期日到場，其於一審辯稱：伊為塑膠射出成型廠，108年10月起受上和公司委託，由上和公司提供模具、原料進行晶圓載片清洗治具之模具試模與製造，產品製造完成後之加工、品檢、包裝、出貨等均係上和公司處理，伊不知系爭產品1、2具有專利權，對於系爭產品1、2之原料、器具及成品均無處置權，其餘引用欣興公司之抗辯。

五、泓揚公司、陳能敏答辯略以：

㈠系爭專利1說明書僅提到「卡合凸塊」、「相卡合」、「互相卡合」、「卡合凹部」，並無「卡合」的定義或解釋，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解「卡合凸塊和傳動元件之間相卡合」的技術內容並可據以實現，違反專利法第120條準用第26條第1項之規定，應為無效。

㈡系爭專利1之請求項1之「該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」（要件1D(2)）為必要之技術特徵，具限定作用，系爭產品3欠缺系爭專利1之請求項1中的「該複數個防呆部包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁，該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」要件，依全要件原則，不構成系爭專利1之請求項1的文義侵害或均等侵害。系爭專利1請求項2至14為請求項1之附屬項，系爭產品3當無侵害系爭專利1請求項2至14之情。

㈢系爭專利2業經行政機關為舉發成立應予撤銷之行政處分，並經本院113年度行專訴字第61號判決維持原處分，是已無侵權之問題。又泓揚公司係依欣興公司提供之設計規範與外觀圖繪圖後，開模製造產品3供欣興公司使用，並未接觸系爭專利，無侵害系爭專利之故意或過失，公司法第23條第2項規定乃以公司負責人本身之行為違反法令始有適用，然本件生產系爭產品之行為主體乃係公司，並非公司負責人，亦無違反法令之處，上訴人逕據上開規定主張被上訴人公司之負責人應負連帶賠償之責，尚屬無據。

㈣並聲明：1.上訴及追加之訴駁回。2.一、二審訴訟費用由上訴人負擔。3.如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

六、超登公司、李月圓答辯略以：

㈠系爭專利1請求項僅以結果功能描述「能與傳動裝置相卡合」但未記載達成該功能所不可或缺之結構配合關係，其請求項內容不明確，違反專利法第26條第1項、第2項、第4項、專利法施行細則第18條第2項；又系爭專利1請求項1至14分別不具新穎性、進步性，具有得撤銷之事由（有效性證據組合詳如言詞辯論意旨狀所載），上訴人不得於民事訴訟中主張權利。

㈡系爭專利1請求項1所稱「該複數個防呆部包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁，該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」，並非僅要求放置架外環壁上存在任意凸出部即可。該「卡合凸塊」應係具有與傳動裝置之傳動元件相互配合並達成穩定輸送功能之結構，而非泛指任何可供上下疊合定位之防呆凸出部。系爭產品4之上、下表面雖分別設有上防呆部及下防呆部，然其功能係供兩個系爭產品上下分離地疊合定位使用，並非用以與傳動裝置相卡合。系爭產品4即為系爭專利1說明書在【先前技術】所述的「現有的防呆設計」相同，因此適用先前技術阻卻。且未有請求項1所界定的「該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」技術特徵，不符合全要件原則，故未落入系爭專利1請求項1至14之專利權範圍。

㈢並聲明：1.上訴及追加之訴駁回。2.一、二審訴訟費用由上訴人負擔。3.如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

七、兩造不爭執事項：（見本院卷一第320-321頁）

㈠上訴人為系爭專利1專屬被授權人，授權期間自109年1月1日至專利1專利期間屆滿日止。

㈡上訴人為系爭專利2專屬被授權人，授權期間自110年1月21日至專利2專利期間屆滿日止。

㈢系爭產品1、2為欣興公司委託上和公司製造，上和公司再委託加逢公司製造，由上和公司販賣予欣興公司使用。

㈣系爭產品3為欣興公司委託泓揚公司製造，由泓揚公司製造後販賣予欣興公司使用。

㈤系爭產品4為欣興公司委託超登公司製造，由超登公司製造後販賣予欣興公司使用。

八、兩造主要爭點：如附表三所載（見本院卷一第321-323頁）。

九、得心證之理由：

㈠系爭專利1之技術分析：

1.系爭專利1所欲解決問題：

晶圓載片上會裝設有晶圓片。在完成晶圓片的裝設後，會對晶圓載片進行電路蝕刻，以及將晶圓載片切割成較小的片狀，完成前述步驟後，為了清除蝕刻電路過程所殘留的油墨，以及清除切割晶圓載片過程所產生的碎屑，會對晶圓載片的表面進行清洗，以避免油墨和碎屑影響晶圓和整片晶圓載片的使用效能。載有晶圓載片的放置架會被放入沖洗用的水道，水道中設有可帶動放置架移動的傳動裝置，傳動裝置通常是會有鏈條或齒盤等結構配合帶動放置架，而在放置架移動的同時，水道內會產生聲波的震動以清除晶圓載片表面上的油墨及碎屑。但是，現有放置架的防呆設計在受傳動裝置傳動時，無法與傳動裝置的傳動元件（如：齒盤、鍊條等）卡合，而讓放置架在受傳動裝置輸送時會滑移或晃動，讓晶圓載片震動或彈跳而產生瑕疵，降低晶圓載片的使用效能，以及產品的良率。為改善現有的技術晶圓清洗裝置的缺失，系爭專利1的防呆部包含複數個卡合凸塊，能和輸送該放置架的傳動裝置相卡合，避免放置架在受傳動裝置輸送時滑移或晃動，提升放置架的輸送穩定度。

2.系爭專利1之申請專利範圍：

系爭專利1申請專利範圍共14項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項（專利說明書見原審卷一第45-69頁）。系爭專利1請求項之內容如附表一所示。主要圖式如附圖一所示。

㈡系爭專利2之技術分析：

1.系爭專利2所欲解決問題：

現有技術的晶圓載片其厚度最大為3㎜，因此位於下方承載件的頂面至位於上方承載件的底面之間所預留的高度為3㎜，當厚度小於3㎜的晶圓載片放置於放置單元的容置空間時，其上方即會產生一閒置空間，當利用超音波或高壓空氣對晶圓載片進行清潔動作時，容易導致晶圓載片產生上下方向的震動，而又因為清洗治具的承載件其頂面為一平面，與晶圓載片為面接觸，當晶圓載片震動時，其貼靠於承載件的部分則會因為連續的敲擊摩擦而產生大面積的刮痕，導致成品的良率下降。有鑒於現有技術的缺點及不足，系爭專利2提供一種晶圓載片清洗治具，其藉由將承載件的抵頂面設置為斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，達到在清洗的過程中降低晶圓載片與抵頂面因為碰撞而產生表面刮痕之目的。

2.系爭專利2之申請專利範圍：

系爭專利2之申請專利範圍共7項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項（專利說明書見原審卷一第71-90頁）。系爭專利2請求項之內容如附表二所示。主要圖式如附圖二所示。

㈢系爭產品技術內容：

1.系爭產品1至4如下，產品照片見附圖三。

	系爭產品型號	侵害之請求項	備註
1	SH23×23	系爭專利1請求項1至14（文義範圍）	欣興公司委託上和公司，上和公司再委託加逢公司製造
2	SH24.5×24.5-V	同上	同上

	3		
3	HY35×35	系爭專利1請求項1至14（文義範圍），系爭專利2請求項1（文義範圍）、請求項3至6（均等範圍）	欣興公司委託泓揚公司製造
4	ZD31×31	系爭專利1請求項1至14（文義範圍）	欣興公司委託超登公司製造

2.系爭產品1、2、3左上角及右上角各有4種不同形狀之凸塊（以數字1至4編號代表不同形狀之卡合凸塊），左下角及右下角各有3種不同形狀之凸塊（以數字1至3編號代表不同形狀之卡合凸塊）。以系爭產品1為例，當兩個放置架上下疊合時，下方放置架之正面凸塊13A、13B、13C、13D僅能與另一位於其上之放置架背面(下面)對應位置的凹部14A、14B、14C、14D結合(正面對正面、或背面對背面於形狀上不對應無法結合)，且兩者上下疊合時，若一個放置架轉向（轉180度）時，兩者則無法重疊，藉由將凸塊13A、13B、13C、13D及凹部14A、14B、14C、14D形狀不對稱設計，使得放置架僅能單一方向上下疊合，構成系爭專利1請求項1之「防呆部」。系爭產品2、3亦同。

3.系爭產品4左上角及右上角各有3種不同形狀之凸塊，左下角及右下角各有3種不同形狀之凸塊（系爭產品4左上角及右上角缺少編號2之凸塊，其餘凸塊具有相同之位置及形狀）。藉由將凸塊13A、13B、13C、13D及凹部14A、14B、14C、14D形狀對稱設計，使得當其中一放置架轉向時兩放置架依然可上下疊合，具有上下反之防呆，不具有前後反之防呆。

㈣系爭產品1至4未落入系爭專利請求項1至14之文義範圍：

1.系爭專利1請求項1可拆解如下4個技術特徵：技術特徵1A「一種具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具」、技術特徵1B「其包含：兩放置架，該兩放置架係能分離地疊合，各放置架其包含一外環壁、複數個放置單元及複數個防呆部」、技術特徵1C「該複數個放置單元排列設在該外環壁

內而受該外環壁圍繞，各放置單元包含一周壁及該周壁圍成的一容置空間」、技術特徵1D「以及該複數個防呆部包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁1D(1)，該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合1D(2)」。

2.系爭產品1至4與系爭專利1請求項1各技術特徵進行文義比對：

⑴技術特徵1A：

由系爭產品1至4照片(見附圖三)可知，系爭產品為四角落具有防呆部之晶圓載片清洗治具，故系爭產品具有與系爭專利1請求項1技術特徵1A相同之技術特徵。

⑵技術特徵1B：

由系爭產品照片顯示其包含：兩放置架(10)，該兩放置架係能分離地疊合，各放置架其包含一外環壁(11)、複數個放置單元(12)。系爭產品1至3左上角與右上角各具有4個凸塊（編號1~4），左下角與右下角各具有3個凸塊（編號1、3、4）。當系爭產品1至3兩個放置架上下疊合時，該下方放置架之正面凸塊13A、13B、13C、13D能與其上之放置架背面對應位置的(下方)凹部14A、14B、14C、14D結合，若兩放置架之正面對正面、或背面對背面上下相疊時，兩者並無法緊密結合(具「上下反」之防呆)，且當兩放置架上下疊合時，若將其中一個放置架轉向(轉180度)時，由於凸塊及凹部之不對稱結構設計，兩者並無法緊密疊合，藉由將凸塊13A、13B、13C、13D及凹部14A、14B、14C、14D形狀及數量之不對稱設計，使得放置架僅能以單一方向上下疊合(具「前後反」之防呆)，系爭產品1至3具有「上下反」及「前後反」之防呆效果，故系爭產品1至3之卡合凸塊構成系爭專利1請求項1之「防呆部」。至於系爭產品4與系爭產品1至3之差異在於，系爭產品4左上角與右上角凸塊之數量均為3個且形狀、位置相同，其對應之凹部

結構設計亦相同，為一對稱結構設計，故當兩個放置架上下疊合時，系爭產品4之下方放置架之正面凸塊13A、13B、13C、13D僅能與位於其上之另一放置架背面對應位置之凹部14A、14B、14C、14D緊密結合，若將兩放置架正面對正面、或背面對背面放置時是無法緊密結合堆疊，而具有「上下反」之防呆，若將其中一個放置架轉向(轉180度)時，由於凸塊及凹部之對稱結構設計，兩者亦可緊密結合堆疊，故系爭產品4僅具有「上下反」之防呆而不具「前後反」之防呆效果。由於系爭專利1請求項1並未記載防呆部之卡合凸塊數量、形狀及佈設位置是否為對稱形式，即並未限定防呆部須同時具有「上下反」及「前後反」之防呆功能，系爭產品4既具有「上下反」之防呆功能，即具有與系爭專利1請求項1技術特徵1B相同之技術特徵。

⑶技術特徵1C：

系爭產品1至4具有外環壁11環繞於該格柵12的外圍，各格柵12(放置單元）包含周壁、且周壁包圍一容置空間，故系爭產品1至4具有與系爭專利1請求項1技術特徵1C相同之技術特徵。

⑷技術特徵1D：

系爭產品1至4之複數個防呆部包含複數個凸塊，其凸設在該外環壁，具有系爭專利1請求項1之1D(1)相同之技術特徵。惟由本院110年度民聲字第22號保全證據事件所拍攝系爭清洗治具實際於生產線機台上運作情形影片（見被證11「00086錄影檔」，原審限閱卷一第367頁，又該影片截圖見本院限閱卷一第456頁、限閱卷二第459-491頁）顯示：當TRAY盤（晶圓載片清洗治具）通過滾輪之前，藍色的滾輪是靜止的，但當通過時，第一支滾輪有被往上提，當TRAY盤通過第一支滾輪後，第一支滾輪就會回到原位，變成第二支滾輪被往上提，接下來TRAY盤通過第二支滾輪後，第二支滾輪就會回到原位，變

成第三支滾輪被往上提，可知滾輪係依序間歇性的往上提，TRAY盤通過時，藍色滾輪被卡合凸塊頂上去，只要TRAY盤一通過就會降回原位，藍色滾輪（壓制輪）係呈現平滑表面並未有設置凹槽(凹部)，當TRAY盤通過滾輪（壓制輪）時兩者雖有抵接，但TRAY盤上外環壁之凸塊與輸送帶或滾輪（壓制輪）間並未有「卡合」作動，故系爭產品1至4不具有系爭專利1請求項1D(2)之技術特徵。

⑸由於系爭產品1至4不具有系爭專利1請求項1所有之技術特徵，未為系爭專利1請求項1文義讀取，故未落入系爭專利1請求項1之文義範圍。系爭專利1請求項2至14為依附於系爭專利1請求項1之附屬項，包含請求項1所有之技術特徵並為進一步限縮，系爭產品1至4未落入系爭專利1請求項1之文義範圍，自未落入系爭專利1請求項2至14之文義範圍。

3.上訴人之主張均不足採：

⑴上訴人雖主張，系爭專利1請求項1要件1D(2)為不具限定作用之功能性子句，縱系爭產品未讀取要件1D(2)內容，亦不影響其落入系爭專利1請求項1之文義範圍，原判決以系爭產品因未具要件1D(2)功能為由，認系爭產品未落入專利1請求項1至14之文義範圍云云，顯係對於專利侵權判斷要點第2.7.5.2點「包含功能性子句之請求項的解釋」有所誤認云云。

⑵惟按，新型專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第120條準用第58條第4項定有明文。於解釋請求項時，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，以確定請求項界定之

範圍。系爭專利1保護之標的為「一種具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具」，其中請求項主體中即已記載「複數個防呆部包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁，該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」。參酌系爭專利1說明書（原審卷一第45-69頁）第【0004】段記載「現有放置架90的防呆設計在受傳動裝置傳動時，無法與傳動裝置的傳動元件（如：齒盤、鍊條等）卡合，而讓放置架90在受傳動裝置輸送時會滑移或晃動，讓晶圓載片80震動或彈跳而產生瑕疵，降低晶圓載片80的使用效能，以及產品的良率…」，第【0005】段記載「為改善現有的技術晶圓清洗裝置的缺失，本創作的防呆部能和傳動裝置相卡合，避免放置架在受傳動裝置輸送時滑移或晃動，提升放置架的輸送穩定度」，第【0007】段記載「所述之具有防呆裝置之晶圓載片清洗治具，其包含兩個所述之防呆部，該兩防呆部為一上防呆部及一下防呆部，該上防呆部及該下防呆部分別位於該放置架的上表面及下表面且能相卡合，該上防呆部與另一該上防呆部無法互相卡合」，由上開系爭專利1說明書之記載可知，系爭專利1之清洗治具具有防呆部包含位於治具上表面且由複數卡合凸塊所構成之上防呆部及位於治具下表面之下防呆部，上防呆部可與另一治具下防呆部卡合，但上防呆部不可與另一治具之上防呆部相互卡合，就此達成治具上下防呆之功能(此為清洗治具之習知技術)。再者，該複數卡合凸塊能與傳動裝置相卡合，避免放置架在受傳動裝置輸送時滑移或晃動，提升放置架的輸送穩定度，此為系爭專利1之創作目的所在，亦即為系爭專利1與習知技術之區別技術特徵。

⑶依據105年版專利侵權判斷要點於2.7.5.1功能性子句之意義：功能性子句通常附加於請求項末段，以描述條件、功能或結果。例如請求項中記載「一種…轉向裝

置，包括:…藉此(whereby)，…，達成快速轉向目的。」其中「藉此(whereby)，…，達成快速轉向目的。」即為「功能性子句」；2.7.5.2包含功能性子句之請求項的解釋：於解釋包含功能性子句之請求項時，該功能性子句對於請求項界定之範圍是否具有限定作用，須視個案之特定事實予以決定，若該功能性子句對於申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟有影響或改變者，則該功能性子句對於請求項界定之範圍具有限定作用，則不得忽略該功能性子句，反之，若功能性子句僅是表示所欲達到之功能或結果時，則其對於請求項界定之範圍不具限定作用。

⑷由前述系爭專利1說明書第【0004】、【0005】段內容可知，系爭專利1之卡合凸塊具有防呆之功能(惟防呆功能為該清洗治具之習知技術)及為改善現有的技術晶圓清洗裝置的缺失，本創作的防呆部能和傳動裝置相卡合，避免放置架在受傳動裝置輸送時滑移或晃動，提升放置架的輸送穩定度，故要件1D(2)之文字敘述內容「該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」為系爭專利1改良習知技術之缺失的技術特徵，即系爭專利1相較習知技術具進步性之技術特徵，此亦經本院113年度行專訴字第63號判決（即系爭專利1之舉發案行政訴訟）所認定。該卡合凸塊需與傳動裝置相卡合始能達成系爭專利1之發明目的及功效，若將該技術特徵視為不具限定作用之功能性子句，在進行新穎性、進步性及侵權要件比對時忽略該技術特徵，則系爭專利1請求項1之凸塊僅具有防呆之功能(此為該治具領域之習知技術)，無法達成系爭專利所稱之效果，質言之，省略或忽略該技術特徵，將造成該請求項有失去可專利性之虞，此解釋與系爭專利1說明書內容不符，更與系爭專利1舉發案之行政訴訟判決認定相違。

⑸另查，系爭專利1請求項1要件1D(2)「該複數個卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」並未使用「藉此…，以達成…目的」功能性子句用語，形式上即未符合該記載之要求，縱認要件1D(2)為功能性子句，參酌系爭專利說明書第【0027】段記載「卡合凸塊與傳動裝置70的齒盤或鍊條等傳動元件71必須要能相卡合，卡合凸塊142的位置是高於各限位件13的上端」，如此方能達成系爭專利1說明書第【0034】段記載「讓該放置架10能更穩定地被該傳動裝置70輸送，避免該複數個晶圓載片80震動或彈跳而產生瑕疵的情形，提升該兩放置架10的輸送穩定度」之目的功效，因此系爭專利1請求項1之「卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」，並非僅表示所欲達到之功能或結果，該「卡合凸塊」具有其特定功能、形式，且須配合傳動裝置上設置有對應之「凹槽」或「凹部」始能使凸塊與傳動裝置「相卡合」，使清洗治具得以被固置、穩定輸送者，並非任意「凸起物」均可隨意取代，並非單純「僅描述功能而不影響清洗治具結構」之描述用語。故要件1D(2)對於申請專利之物的結構有影響或改變，對於請求項界定之範圍具有限定作用，於侵權比對時，應作為一限制條件而納入比對。

⑹上訴人雖主張，系爭專利1申請之範圍為治具而非傳動裝置，請求項1要件1D（2）「該複數個卡合凸塊『能』與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合」，該「能」在解釋上只要可以跟任何一個傳動裝置相卡合即可，並不一定要與欣興公司現在所使用的傳動裝置卡合云云。惟查，系爭專利1請求項1之「卡合凸塊」無論是請求項文字或是參酌說明書及圖式，已明確揭示該專利主要技術特徵即是透過「卡合凸塊14」與「傳動元件71」相卡合，始能使清洗治具被穩定輸送。故系爭專利1請求項1要件1D（2）「卡合凸塊」具有其特定功能、形式，必

須可與傳動裝置相卡合，使清洗治具得以因此被固置、穩定輸送者方屬之，該凸塊之設計必須與傳送該治具之傳動裝置間具有相互匹配之對應結構，始能具有卡合之功能，進而達成系爭專利1之功效，若如上訴人所稱卡合凸塊並不一定要與傳動裝置卡合，則單獨之卡合凸塊僅具有防呆之效果，並無達成系爭專利1所稱使清洗治具得以被固置、穩定輸送之功效。本院114年11月3日準備程序上訴人訴訟代理人陳律師陳稱：「依據我們的請求項內容，這個凸設於外環壁的卡合凸塊可以與某些特定設計的傳動裝置相卡合，但不能據以認定為所有傳動裝置皆會做這些設計，因此系爭專利的設計並非能與所有的傳動裝置卡合」；另一訴訟代理人陳專利師陳稱：「即便無法與所有傳動裝置卡合，但是只要這個清洗治具具有卡合凸塊，就能夠達成系爭專利所界定『能夠跟某些傳動裝置相卡合』的功能。」（見本院卷二第323頁），上訴人訴訟代理人上開主張之邏輯似有矛盾之處，惟已自承系爭專利1之卡合凸塊並非可與所有的傳動裝置相卡合，必須與具有相對應卡合結構(凹槽或凹部)之傳動裝置始能協同運作進而達成系爭專利1之發明目的。則依專利侵權比對之「全要件原則」，上訴人應證明系爭產品實際使用於清洗傳送機台時，是否確能與傳送裝置相卡合，始能認定被上訴人等有侵害系爭專利1之行為。

⑺本院依欣興公司之聲請，於114年12月24日函請訴外人揚發公司（欣興公司新豐廠區清洗機台供應商）提供該公司自2020（109）年1月1日起迄發函時止，供應予欣興公司「新豐廠區」之清洗機、水洗機、收放板機等機台之「壓制輪」的設計圖、完整照片及產品實物到院(見本院卷二第391頁)，依揚發公司於115年1月28日函覆資料(見本院卷二第467-495頁)及壓制輪實物（存證物盒）所示，欣興公司新豐廠區之清洗機台所使用之

「壓制輪」為平滑表面之滾輪，滾輪上並未有任何之「凹槽」設計，核與證據保全程序所拍攝之影片及欣興公司113年3月27日庭提簡報互核相符(見原審限閱卷一第367頁、本院限閱卷一第455-456頁)，堪予採認，系爭產品於清洗機台實際使用時，該傳動裝置之壓制輪並未與系爭產品之凸塊「相卡合」，無從認定系爭產品落入系爭專利1之專利權範圍。

⑻上訴人又主張，欣興公司另案（111年度民專訴字第52號）所提出書狀（上證1，見本院限閱卷一第77-79頁）可證明系爭產品之卡合凸塊可與欣興公司之網帶輸送機（傳動裝置）相卡合云云。惟欣興公司否認之，並辯稱上證1所指之機台僅為評估性機台，經該公司評估後認為成本過高，並未實際使用於產線(見本院限閱卷三第10頁)，就此，上訴人並未提出欣興公司有實際使用該網帶輸送機之事證。再者，參酌欣興公司對於上證1運用網帶輸送TRAY盤方式之說明「網帶輸送機之輸送方式為：將TRAY盤置於下網帶上，使上網帶覆蓋高度降低之後，具有「尖角」設計（即上圖深藍色梯形部分）的TRAY盤四角突起處可以穿過上網帶之網帶框。由於網帶具有彈性且TRAY盤四角突起處有『尖角』設計，因此使網帶覆蓋高度降低之後可使『修改為尖角設計的TRAY盤四角突起處』較容易地穿過網帶，並可藉由網帶的彈性與之齧合、藉此進行TRAY盤之輸送。」(本院限閱卷一第462頁)，可知係由TRAY盤四角凸起處的尖點穿過網帶，網帶之彈性與之齧合，藉此進行TRAY盤之輸送，該凸起與網帶間並非以「卡合」方式作動，與系爭專利1之技術手段並非相同，況且上訴人亦未提出欣興公司有將系爭治具產品實際使用於網帶輸送機之證據，尚難認定被上訴人等有侵害系爭專利1之行為。

⑼綜上，無論由證據保全程序所拍攝之機台運作影片或訴外人揚發公司回覆之內容，均不能證明系爭產品1至4有

使用系爭專利1之請求項1要件1D（2）技術，故不能證明系爭產品侵害系爭專利1請求項1至14。

㈤系爭專利2請求項1、3至6具有應撤銷之事由：

1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，修正前智審法第16條定有明文。查系爭專利2申請日為2020年9月18日，經審定准予專利後，於2021年1月21日公告。是以，系爭專利2是否有應撤銷專利權之原因，應以核准審定時所適用之108年5月1日公布，108年11月1日施行之專利法規定為斷。

2.被證3不足以證明專利2請求項1、3至5不具新穎性及進性：

⑴被證3為中國第CN210272284公告號「具有防呆裝置的晶圓載片清洗治具」實用新型專利案（專利說明書見原審卷一第587-604頁）。被證3公告日(2020年4月7日)係早於系爭專利2申請日(2020年9月18日)，可為系爭專利2之先前技術。被證3為一種具有防呆裝置的晶圓載片清洗治具，其包含：能分離地疊合的兩放置架，各放置架包含外環壁、放置單元及防呆部，放置單元排列受外環壁圍繞，各放置單元包含周壁及周壁圍成的容置空間，防呆部包含多個卡合凸塊，其凸設在外環壁，卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合；為改善現有的技術晶圓清洗裝置的缺失，實用新型的防呆部能和傳動裝置相卡合，避免放置架在受傳動裝置輸送時滑移或晃動，提升放置架的輸送穩定度。被證3主要圖式如附圖四所示。

⑵被證3實用新型名稱「具有防呆裝置的晶圓載片清洗治具」，可對應系爭專利2請求項1「一種晶圓載片清洗治

具」技術特徵1A；被證3請求項1記載「包含：兩放置架，該兩放置架能分離地疊合，各放置架包含一外環壁、多個放置單元，該多個放置單元排列設在該外環壁內而受該外環壁圍繞」，由被證3圖1可看出被證3之「外環壁」為環狀框體，可對應系爭專利2之「外框」，故被證3請求項1、圖1可對應至系爭專利2請求項1「其包含：二放置架，其結構相同且能分離地相互疊合，各該放置架包含一外框及複數放置單元，該外框為一環狀框體，該複數放置單元排列設置在該外框內」技術特徵1B；被證3請求項1記載「各放置單元包含一周壁及該周壁圍成的一容置空間」、被證3請求項9記載「各放置單元包含多個承載件，該多個承載件不相連，各承載件設在該周壁、突入該容置空間且包含一頂面」、被證3說明書第【0052】段記載「各放置單元12會被該多個限位件13導入容置空間並受該多個乘載件122支撐」，比較被證3圖3與系爭專利2圖3，可看出被證3「周壁121」對應系爭專利2之「內框」，被證3「承載件122」對應系爭專利2之「承載件」，被證3「限位件13」對應系爭專利2之「上限位件」，故被證3請求項1、9、說明書第【0052】段與圖3可對應至系爭專利2請求項1「各該放置單元包含一內框、複數承載件及複數上限位件，該內框圍繞形成一容置空間，該複數承載件環繞間隔凸設於該內框上且朝向該容置空間突伸」技術特徵1C；被證3請求項10記載「各限位件設在該周壁的頂面」，由被證3圖3可看出複數限位件13環繞間隔凸設於周壁121上，故被證3請求項10與圖3可對應至系爭專利2請求項1「該複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面」技術特徵1E。

⑶被證3說明書第【0045】段與圖1至3、8揭示承載件122包含一頂面，該頂面朝向上方且為凸面，揭示系爭專利2請求項1技術特徵1D(1)「各該承載件具有一抵頂

面」，由被證3圖9可知承載件122頂面雖為一凸面，但不具有自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜斜面之特徵，被證3並未揭示系爭專利2請求項1技術特徵1D(2)「該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度」，被證3不足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性。

⑷由系爭專利2說明書第【0021】段記載可知將承載件與晶圓載片接觸部分改成斜面之抵頂面，由面接觸改為線接觸係系爭專利2能達到其發明目的的重要技術特徵，具有降低晶圓載片表面的刮痕，進而提升產品的品質、降低產品的不良率的功效，難謂系爭專利2請求項1技術特徵1D(2)為該技術領域中具有通常知識者能利用申請時之通常知識簡單進行修飾、置換、省略或轉用即可完成，故被證3亦不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

⑸欣興公司雖主張，被證3圖8、9已清楚標示承載件具有一斜面，系爭專利2請求項用語並未限制抵頂面與晶圓載片之相對關係，被證3亦呈現與平面或直線呈現斜角關係，通常知識者可透過承載件簡單變更，進而揭露系爭專利2請求項1要件1D技術特徵云云。惟查，系爭專利2說明書第【0016】段記載「承載件123為一自內框121朝向容置空間122突伸之塊體，其具有一抵頂面124及一底面125，抵頂面124為一斜面，抵頂面124自位於內框121上方位置朝向容置空間122的方向向下傾斜」；第【0021】段記載「各晶圓載片20會被上限位件126導入容置空間122直至晶圓載片20的下緣貼靠於承載件123的抵頂面124而停止，此時承載件123與晶圓載片20之間是以線接觸的方式貼靠達到承載之目的」，再參諸系爭專利2

圖3、4，可知系爭專利2承載件之頂面雖為凸面，但自頂面向下傾斜之抵頂面為直線的斜面，且承載件與晶圓載片下緣接觸的部位為「抵頂面」而非承載件頂面或其他非抵頂面的部位(如系爭專利2圖3清洗治具局部放大圖之橘線所示)。然被證3說明書第【0045】段記載「各承載件122突入該容置空間，且該承載件122包含一頂面，該頂面朝向上方且為凸面」；第【0052】段記載「請參看圖8及圖9……各放置單元12會被該多個限位件13導入容置空間並受該多個承載件122支撐」，再參諸被證3圖8、9，可看出承載件122頂面為凸面，晶圓載片下緣係與「承載件頂面」接觸，故被證3與系爭專利2之載片與承載件接觸面不同，兩者降低碰撞刮痕的效果也不相同，被證3無具體教示或建議如何變更載片與承載件之接觸面，無法由被證3晶圓載片底面與承載件頂面之面接觸方式，改變為晶圓載片底面、側面之轉角與承載件抵頂面之線接觸方式，其差異並非發明所屬技術領域中具有通常知識者經由簡單變更所能輕易完成，欣興公司上開主張並不足採。

⑹系爭專利2請求項3至5皆直接或間接依附於請求項1，包含請求項1所有技術特徵，並為進一步之限縮，被證3不足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性、進步性，當然亦不足以證明系爭專利2請求項3至5不具新穎性、進步性。

3.被證3、被證4之組合足以證明專利2請求項1、3至6不具進步性：

⑴被證4為我國第M561912公告號「晶片承載裝置」新型專利案（專利說明書見原審卷一第605-628頁），被證4公告日(2018年6月11日)係早於系爭專利2申請日(2020年9月18日)，可為系爭專利2之先前技術。被證4為一種晶片承載裝置，包含一基座、一設置於該基座上表面的限位單元，及一設置於該基座下表面的嵌合單元。該限位

單元包括一凸設於該基座上表面且界定出一第一凹槽的第一圍繞壁，及複數凸設於該第一圍繞壁上且環狀相間隔設置的限位壁，該等限位壁相配合界定出一連通該第一凹槽的承載空間，每兩相鄰限位壁間界定出一連通該承載空間的間隙。該嵌合單元包括一凸設於該基座下表面的第二圍繞壁、一設置於該第二圍繞壁上的承置壁，及複數凸設於該承置壁上的定位壁。當兩個上下疊置的晶片承載裝置分離時，由於該基座之間不會連通，因此不會形成吸孔，且空氣可由該等間隙流出，如此將形成一將該晶片下壓並定位於該承載空間內的氣流，可避免該晶片因兩個上下疊置的晶片承載裝置開啟分離時被吸起或掀覆。被證4主要圖式如附圖五所示。

⑵系爭專利2請求項1：

①被證3揭露系爭專利2請求項1技術特徵1A至1C、1E已如前述，被證4說明書第【0009】段記載「四個環狀相間隔地凸設於該第一圍繞壁51上且各自形成一傾斜面520的限位壁52…該等傾斜面520相配合界定出一連通該第一凹槽510的承載空間521」；第【0011】段記載「該晶片C的外周緣會靠抵於該晶片承載裝置3a之該等傾斜面520上」，再參諸被證4圖4、6，可看出被證4揭露之限位壁52具有一傾斜面520，由第一圍繞壁51的上方位置向第一凹槽510的方向向下傾斜，其中傾斜面520高點與最低點之間連接之假想線與傾斜面最高點的假想水平線之間具有一傾斜角度，當晶片C置放於乘載空間521時，晶片C的外周緣會靠抵於傾斜面520上形成線接觸(如附圖五圖6所示)。因此被證4之「傾斜面520」對應系爭專利2之「抵頂面」，被證4之「乘載空間521」對應系爭專利2之「容置空間」，故被證4說明書第【0009】、【0011】段與圖4、6可對應至系爭專利2請求項1技術特徵1D(1)、1D(2)。

②被證3與被證4皆為製造過程中用於元件承載裝置之技術領域，參以國際專利分類號(IPC)同屬H01L21，被證3揭露以限位件導入容置空間並以承載件接觸晶圓載片，被證4則教示並建議承載件係以傾斜面的方式與晶片接觸，故被證3、被證4具有相同導入與承載電子元件之功能共通性，綜合考量被證3、被證4具有技術領域關連性和功能共通性，該所屬技術領域中具有通常知識者自有動機結合被證3、被證4揭露之技術內容，將被證4之傾斜面結構應用於被證3之承載件上，完成系爭專利2請求項1技術特徵1D(1)、1D(2)。故被證3已揭示系爭專利2請求項1技術特徵1A至1C、1E，被證3、被證4之組合已揭示系爭專利2請求項1技術特徵1D，且被證3、4具有結合動機，被證3、被證4之組合足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

③上訴人雖主張，被證3、被證4係分別適用於半導體產業鏈中不同階段，非屬同一領域，且被證3係為解決晶圓載片運輸過程彈跳滑動產生的瑕疵問題，而被證4則是在解決晶片承載裝置分離時被吸起或掀覆，二者所欲解決問題並不相關，故被證3、被證4並無結合動機，又被證4不具貫孔，無法與需使用於「清洗」製程之被證3相結合，否則清洗時將有水分累積於凹槽中無法排除之問題云云。惟查，被證3、4皆為製造過程中用於承載元件之裝置，具有技術領域關連性，且被證3、被證4均歸類於國際專利分類H01L21之次目下（見被證3、被證4專利說明書第1頁國際分類號二），被證3、被證4具有技術領域之關聯性；被證3、4皆具有放置晶圓載片使得在製程中運送晶圓載片時使晶圓載片不會碰撞、散亂而損壞晶片，具有功能或作用之共通性；被證3說明書第【0052】段記載「晶圓載片80放入該放置單元12的容置空間時…各放置單元12會被該多個限位件13導入容置空間並受該多

個承載件122支撐」、被證4說明書第【0011】段記載「將該晶片C置於該晶片承載裝置3a之承載空間521內，前述的置入過程中，該晶片C的外周緣會靠抵於該晶片承載裝置3a之該等傾斜面520上」，被證3已揭露以承載件接觸晶圓載片，被證4則教示並建議承載件係以傾斜面的方式與晶圓載片接觸，故被證4已教示或建議可與被證3結合。綜合考量被證3、4間技術內容的關連性和共通性，該技術領域中具有通常知識者自有動機以結合被證3、4揭露之技術內容，將被證4之傾斜面結構應用於被證3之承載件上，完成系爭專利2請求項1技術特徵1D。另被證4圖4至10之第一凹槽510下方雖未顯示具有貫孔，惟被證4已將晶片容置於晶片承載裝置之間，被證3說明書亦揭示放置於陰涼處陰乾，而通常知識者經由傾倒方式亦可將水分由溝槽631排除，因此在被證3、被證4未存在反向教示情況下，仍應認定被證3、被證4具有結合動機，上訴人之上開主張，尚不足採信。

⑶系爭專利2請求項3：

系爭專利2請求項3依附於請求項1或2，被證3及被證4之組合足以證明系爭專利2請求項1不具進步性，已如前述，系爭專利2請求項3進一步界定「各該上限位件為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少」附屬技術特徵3A。經查，被證3說明書第【0045】段記載「該限位件13的外徑是由其上端向下逐漸遞增」；第【0052】段記載「各限位件13是外徑由上端向下逐漸遞增的柱體」，再參被證3圖3、9，可看出被證3之限位件13為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少，被證3已揭露系爭專利2請求項3之附屬技術特徵3A，故被證3及被證4之組合足以證明系爭專利2請求項3不具進步性。

⑷系爭專利2請求項4、5：

系爭專利2請求項4依附於請求項3，請求項5依附於請求項4，被證3及被證4之組合足以證明系爭專利2請求項3不具進步性，已如前述，系爭專利2請求項4進一步界定「各該放置單元進一步包含複數下限位件，各該下限位件環繞間隔凸設於該內框的底側面」附屬技術特徵4A，系爭專利2請求項5進一步界定「該複數下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方方向延伸逐漸減少」附屬技術特徵5A。經查，被證3圖6係清洗治具放置架的背面仰視圖，由被證3圖6可看出其揭露之清洗治具具有複數下限位件，且下限位件環繞間隔凸設於該內框的底側面，其中下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方方向延伸逐漸減少，被證3已揭露系爭專利2請求項4之附屬技術特徵4A及請求項5之附屬技術特徵5A，故被證3及被證4之組合足以證明系爭專利2請求項4、5不具進步性。

⑸系爭專利2請求項6：

系爭專利2請求項6依附於請求項5，被證3及被證4之組合足以證明系爭專利2請求項5不具進步性，已如前述，系爭專利2請求項6進一步界定「該抵頂面的向下傾斜角度為20度」之附屬技術特徵6A。經查，被證4說明書第【0009】、【0011】段及圖4、6已揭露與晶圓載片接觸之傾斜面高點與最低點之間連接之假想線與傾斜面最高點的假想水平線之間具有一傾斜角度。被證4圖6已揭露由晶片承載裝置3a、3b相疊，中間形成容置晶片之空間，該晶片承載裝置3b下方內側輪廓具有一由外側往中心之向上傾斜角度，因被證4已揭示晶片C外周緣會抵靠晶片承載裝置3a之該等傾斜面520上，通常知識者由被證4教示可得知當承載裝置3a、3b上下顛倒或傾倒時，晶片C外周緣仍以線接觸方式接觸晶片承載裝置3a下方內側之傾斜面520。因系爭專利2說明書中並無說明傾斜角度設定為20度有產生任何特殊功效或與其他角度相比有何特殊之處，故被證4雖未揭露該傾斜角度數值，然

該技術領域中具有通常知識者經由模擬設計調整傾斜規格而無須過度實驗，即可輕易得知傾斜角度可設為20度，被證3及被證4之組合足以證明系爭專利2請求項6不具進步性。

4.被證3、被證25之組合足以證明系爭專利2請求項1、3至6不具進步性：

⑴被證25為中國CN第205810771公告號「自定位晶圓承盤」實用新型專利案（專利說明書見原審卷三第247-258頁）。被證25公告日(2016年12月14日)係早於系爭專利2申請日(2020年9月18日)，可為系爭專利2之先前技術。被證25係一種自定位晶圓承盤，其主要是由一基底部，及該基底部的一側的複數個第一容置結構，與另一側對應該第一容置結構且相等數量的複數個第二容置結構構成。且容置結構的容置功能是由複數個平斜面，及複數個弧斜面構成，兩者與晶圓本體構成線接觸的放置方式，以減少平面摩擦，產生降低損壞及精確定位的功能。且各該平斜面和各該弧斜面可以使彈跳出的晶圓，能沿各該平斜面及各該弧斜面復位。另外容置結構上還有定向的限位構造，以便晶圓同向放置。被證25之主要圖式如附圖六所示。

⑵系爭專利2請求項1：

①被證3已揭露系爭專利2請求項1之1A至1C、1E技術特徵，已如前述，被證25說明書第【0025】段記載「該第一容置結構20具有一由該基底部10突出以圈圍出一第一晶圓槽211的圓環21以及四個設置於該圓環外側面的第一限位件22。該圓環21的內側有朝向該圓環21中心傾斜的一弧斜面212以及一平斜面213」；第【0027】段記載「晶圓50置放於該第一容置結構20的第一晶圓槽211中時，該晶圓50的平面邊緣51對應該平斜面213，該弧面邊緣52對應該弧斜面212的部分」，再參諸被證25圖1、5，可看出被證25揭露之晶圓承盤中

與晶圓接觸部分為圓環21的內側弧斜面212及平斜面213，由圓環21的上方位置向穿孔40的方向向下傾斜，其中弧斜面212及平斜面213的高點與最低點之間連接之假想線與最高點的假想水平線之間具有一傾斜角度(如被證25圖1)，當晶圓50置放於第一晶圓槽211時，晶圓50的外周緣會靠抵於弧斜面212及平斜面213上形成線接觸(如被證25圖5)。因此被證25之「弧斜面212」或「平斜面213」對應系爭專利2之「抵頂面」，被證25之「第一晶圓槽211」對應系爭專利2之「容置空間」，故被證25說明書第【0025】、【0027】段與圖1、5可對應至系爭專利2請求項1技術特徵1D。被證3與被證25皆為製造過程中用於元件承載裝置之技術領域，國際專利分類號(IPC)同屬H01L21/673，被證3揭露晶圓載片以限位件導入容置空間，並以承載件接觸晶圓載片，被證25說明書第【0027】段揭露因弧斜面212及平斜面213呈傾斜狀態，晶圓自動滑至適當位置定位，且弧斜面212及平斜面213上以線接觸的方式與晶圓外周緣接觸，被證3、被證25同樣具有導入與承載電子元件之功能共通性，綜合考量被證3、被證25具有技術領域關連性和功能共通性，該所屬技術領域中具有通常知識者自有動機結合被證3、被證25揭露之技術內容，將被證25之傾斜面結構應用於被證3之承載件上，完成系爭專利2請求項1技術特徵1D(1)、1D(2)。故被證3已揭示系爭專利2請求項1技術特徵1A至1C、1E，被證25已揭示系爭專利2請求項1技術特徵1D，且被證3、被證25具有結合動機，被證3、被證25之組合足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

②上訴人雖主張，被證3係「電路板」(即PCB板、IC載板)，所適用對象並非半導體產業，被證25為半導體上游「晶圓」，不具有技術領域關聯性，在所欲解決

問題上，二者也不具共通性，欠缺結合動機云云，惟查，被證3、被證25具有相同之導入與支撐功能，被證3、被證25具有技術領域之關聯性，已如前述。IC載板相較於傳統PCB具有更輕薄短小與更精細線路，是半導體封裝的關鍵高精密零組件，它在裸晶與印刷電路板間作為中間媒介，具有承載晶片、保護電路、散熱、連接晶片與PCB等功能，兩者不僅相關且密不可分，IC載板所適用對象仍為半導體產業，上訴人主張不可採。

⑶系爭專利2請求項3：

系爭專利2請求項3依附於請求項1或2，並進一步界定「各該上限位件為一錐狀體，其外徑朝向上方方向延伸逐漸減少」之附屬技術特徵3A，被證3及被證25之組合足以證明系爭專利2請求項1不具進步性，被證3已揭露系爭專利2請求項3技術特徵3A，及被證3及被證25具有組合動機，均如前述，故被證3及被證25之組合足以證明系爭專利2請求項3不具進步性。

⑷系爭專利2請求項4、5：

系爭專利2請求項4依附於請求項3，請求項5依附於請求項4，請求項4進一步界定「各該放置單元進一步包含複數下限位件，各該下限位件環繞間隔凸設於該內框的底側面」之附屬技術特徵4A，請求項5進一步界定「該複數下限位件為錐狀體，其外徑朝向下方方向延伸逐漸減少」之附屬技術特徵5A，被證3及被證25之組合足以證明系爭專利2請求項3不具進步性，被證3圖6係清洗治具放置架的背面仰視圖，被證3已揭露系爭專利2請求項4、5之附屬技術特徵4A、5A，被證3及被證25具有組合動機，均如前述，故被證3及被證25之組合足以證明系爭專利2請求項4、5不具進步性。

⑸系爭專利2請求項6：

系爭專利2請求項6依附於請求項5，並進一步界定「該抵頂面的向下傾斜角度為20度」，被證3及被證25之組合足以證明系爭專利2請求項5不具進步性之理由，已如前述，被證25說明書第【0026】段及圖2已揭露與晶圓接觸之傾斜面高點與最低點之間連接之假想線與傾斜面最高點的假想水平線之間具有一傾斜角度。被證25圖8已揭露由第一容置機構20、第二容置機構30相疊，中間形成容置晶圓之空間，該第二容置機構30下方之第二晶圓槽311內側輪廓具有一由外側往中心之向上傾斜角度，因被證25說明書第【0027】段已揭示晶圓50外周緣會抵靠第一容置機構20之弧斜面212以及平斜面213上構成線接觸狀態，通常知識者由被證25教示可得知當第一容置機構20、第二容置機構30上下顛倒或傾倒時，晶圓50外周緣仍以線接觸方式接觸第一晶圓槽211之弧斜面212以及平斜面213，或以線接觸方式接觸第二晶圓槽311之傾斜面。因系爭專利2說明書中並無說明傾斜角度設定為20度有產生任何特殊功效或與其他角度相比有何特殊之處，故被證25雖未揭露該傾斜角度數值，然該技術領域中具有通常知識者經由模擬設計調整傾斜規格而無須過度實驗，即可輕易得知傾斜角度可設為20度，被證3及被證25之組合足以證明系爭專利2請求項6不具進步性。

5.綜上所述，被證3、被證4之組合，及被證3、被證25之組合均足以證明系爭專利2請求項1、3至6不具進步性，系爭專利2請求項1、3至6具有應撤銷之原因，依修正前智審法第16條規定，上訴人不得於民事訴訟中對於被上訴人主張權利，其主張被上訴人等侵害系爭專利2之專利權，即非可採。

十、據上所述，系爭產品1至4未落入系爭專利1請求項1至14之文義範圍，系爭專利2請求項1、3至6具有應撤銷之原因，上訴人主張被上訴人等侵害系爭專利1、2，依專利法第120條準

用第96條第1至4項、第97條第1、2項、民法第184條第1項前段、民法第185條第1項、公司法第23條第2項規定，請求被上訴人各別就其等侵害系爭專利權之行為負連帶損害賠償責任，及請求排除侵害、並將從事侵害系爭專利之原料與器具予以回收、銷毀，均無理由，原審駁回上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請，並無違誤，上訴人提起上訴，求予廢棄改判，並為訴之擴張，均無理由，應予駁回。

□、本件事證已臻明確，兩造間其餘之爭點及攻擊防禦方法暨所提證據，經本院審酌後認與判決之結果不生影響，爰不予逐一論列，附此敘明。

□、據上論結，本件上訴及擴張之訴均無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　7　　月　　29　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　7　　月　　29　　日

書記官　李建毅

附註：

民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴

人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。